長プロセス開発を加速する **b**映像装置 Scanning Acoustic Tomograph to Accelerate Development of Surface Mount Process

山本 弘 Hiroshi Yamamoto 牧原 昇也 Syouya Makihara 竹内 健 Ken Takeuchi 柳本 裕章 Hiroaki Yanagimoto

マルチメディア時代を迎えて、エレクトロニクス実装分野では、 機器システムの高機能化や高性能化とともに小型・軽量化への動きが激化している。 これに対応するには、LSIのプロセス微細化による高集積化だけでは限界があり、 高密度実装技術の導入が必要になってきた。 それに伴い、実装における接着(接合)部の信頼性評価の重要性はいっそう増している。 日立建機株式会社は、物体の内部を可視化できる超音波映像装置 (SAT) について、 キーテクノロジーである超音波探触子の高性能化、操作性の向上に焦点を当てて研究を進めてきた結果、 実装の開発段階で必要不可欠となる検査ツールを開発した。

1. はじめに

エレクトロニクス実装分野では、システムの高機能化や 高性能化とともに小型軽量化要求への対応が進み、実装形 態は二次元の高密度実装から三次元へ急速に移行してい る。この三次元実装構造は、基板上への複数のLSI (Largescale Integration) チップの搭載にとどまらず、三次元貫通 配線構造を有したLSIチップそのものの積層化や部品内蔵 基板の採用など,多様な形態へと進化している¹⁾。また, 環境負荷物質の低減という観点から, EUでは RoHS 指令 (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:特定有害物質使 用制限指令) が2006年7月から施行され、回路基板の実 装用はんだについても、既存のSn/Pb共晶はんだからPb フリーはんだへ移行している。メーカーは、これまで使用 してきたプロセスの大幅な見直しを迫られている現状であ り、信頼性試験や不具合解析を改めて実施する必要が生じ ている。

ここでは、実装における接合(接着)部の非破壊評価と して,超音波を利用した検査装置である超音波映像装置 (SAT: Scanning Acoustic Tomograph)の開発^{2), 3)}, およ びその技術応用について述べる(図1参照)。

2. 超音波による欠陥検出の原理

超音波とは、周波数20 kHz以上の人間の耳では聞こえ ない音のことであり,超音波を用いて非破壊で工業部品内 部を検査するのが超音波検査法である。この検査法は他の 検査法に比べ,き裂や剥(はく)離の検出能力が優れており,

電子部品の信頼性評価や故障解析に多用されている。超音 波測定の原理を図2に示す。超音波探触子内にある圧電素 子が、パルス電圧の印加によって振動し、この振動によっ て発生した超音波を試験体に照射すると、弾性波として内 部を伝播(ぱ)する。内部にボイド,クラックや異物が存 在すると音響インピーダンス (密度と音速の積) の変化が 起きるため、反射・屈折といった挙動を示す。図1のIC (Integrated Circuit) パッケージで言えば、シリコンチッ プとモールド樹脂界面,樹脂中のボイド,チップクラック などがこれに相当する。反射率は接している二つの材質の 組み合わせによって異なり、状態の差が反射波強度の差と して表れる。特に密度が桁(けた)外れに小さい空気の場合, 反射率はほぼ100%となるため、これが空隙(げき)を精 度よく検出する大きな要因となっている。今後,付加価値 の高いLSI、特にスタックドICに代表される積層タイプ のLSIは、初期段階での評価が重要視されてくる。超音波 検査はその評価のための、検査ツールを担っていくものと 予想される。

3. 超音波映像装置構成機器へのニーズ

3.1 超音波探触子の高性能化

超音波検査において、電気信号の入出力部に相当する超 音波探触子の性能は、その装置性能を大きく左右すると 言っても過言ではなく、いかに効率よく超音波を送受信す るかがキーとなる。今後、進化し続ける半導体パッケージ 評価において、試料の小型化に対しては、超音波探触子よ り発せられる超音波ビームをより細く絞るために超音波周



図1 超音波映像装置 (SAT)

超音波を利用して、半導体内部を非破壊で検査する日立建機株式会社の超音波映像装置「FS300II」の外観と画面例、フルデジタルで全点波形データを保存して三次元表示可能 なソフトウェアによる代表的なICパッケージの超音波探査例、および、超音波映像装置で観察できるICパッケージの内部欠陥を示す。

波数の高周波化が,また試料の薄型化に対しては,接合界 面からの反射波を精度よく分離するために超音波パルス幅 の極短パルス化がそれぞれ求められている。

3.2 操作性の向上

超音波検査では,集束した超音波を検査したい接着(接合)界面に,いかにして合わせるかが評価するうえで最も 重要なポイントとなる。鮮明な映像を採取するために,超



図2 超音波測定の原理

材料の物性値である音響インピーダンス(密度と音速の積)の差によって超音波の反 射波強度が変化する。この性質を利用して,非破壊で内部を検査することができる。 音波映像装置では超音波探触子の音響特性や媒体,被検査 体内部の音速値により,所望の深さの位置に集束した超音 波の焦点を設定する,焦点合わせ作業が必要となってくる。 従来,この焦点合わせの作業は,オシロスコープなどを使 用して試験体からの反射波形を観察して行っていた。しか し,検査対象である被検査体に応じて行わなければならな い焦点合わせについては,検査対象物に応じて決まること なので,あらかじめデータ設定により操作を簡単にしてお くことが実作業ではきわめて困難であり,鮮明な映像を採 取するためには,従来から自動焦点合わせ機能が強く求め られていた。

4. 超音波映像装置構成機器の開発

4.1 超音波探触子の高性能化へのアプローチ

従来,超音波探触子の研究は,超音波顕微鏡用探触子の 開発でもあった。すなわち,材料の物性解析が主とした研 究であるため,焦点距離は短いものであった。それに比べ て,超音波検査は非破壊で内部の情報を可視化できる技術 であるため,焦点距離の長い探触子が必要となってくる。 そこで,日立製作所中央研究所で開発された100 MHz超 音波変換器用ZnO薄膜の研究⁴⁾をベースにして,超音波 を集束するための音響レンズの加工精度向上と音響整合層 について独自に研究開発し,高感度・高性能の超音波探触 子を製品化した。

スタックドICの検査例を図3に示す。開発した高周波 超音波探触子により、ダイアタッチフィルムの上下それぞ れに焦点を合わせた探査映像を示す。S/N(Signal-to-noise)



図3 ダイアタッチフィルムの検査例

ペア状態でダイアタッチフィルムを評価した例を示す。ダイアタッチフィルムの厚みが 20 µmであり、その表裏界面を分離して映像化した。

比がよく,各接触界面でのボイドを検出していることがわ かる。従来,50 MHz以下の超音波探触子において,圧電 素子としての圧電セラミックスと音響レンズ,圧電セラ ミックスとバッキング材の接合には接着剤が使用されてい た。接着剤の使用から,吸湿による経年変化は避けられず, 超音波探触子の感度低下,耐用年数の低下につながってい た。そこで,日立製作所機械研究所で開発された接着剤を 使用しない接合技術である低温接合技術⁵⁾を利用して接着 剤が介在しない,経年変化のない,短パルスの高感度な超 音波探触子もあわせて製品化することができた。

4.2 操作性向上へのアプローチ(Sイメージ自動取得)

超音波探触子を試料に対し斜め走査して,超音波画像を 取得する。試料断面に対して階段状Stairing(あるいは Slope, Slat)の画像であることから略して「Sイメージ⁶⁰」 と称している。このSイメージ技術は,超音波の送受信回 路と走査機構が外部制御方式であるために,各測定点にお いて得られたデータ(映像上の各画素)と測定パラメータ とを対応させて記憶することに着目した自社開発技術で ある。

Sイメージは,超音波の専門家でないユーザーでも,任 意の界面に焦点を合わせて検査ができる,世の中に初めて 紹介されたものであるが,ユーザーサイドにとって大きな メリットとなり,超音波検査の普及に大きな影響を及ぼし た(図4参照)。

4.3 高精細画像取得へのアプローチ

超音波映像装置において,パルス波励振により得られた 超音波信号は,媒質や試料中で減衰を受けるため,受信信 号の中心周波数は低周波領域へシフトする。一方,超音波 顕微鏡で用いられているバースト波信号の励振では,送信



図4 「**Sイメージ」の原理** 上の図はICパッケージを例にしたSイメージ映像結果である。

	0.2 mm
(A)バースト波使用による結果	(B)インパルス波使用による結果

図5 印加バルスの違いによる映像比較(周波数:200 MHz) 超音波顕微鏡で使用されているバースト波を印加電圧に使用することで、受信周波数 を向上するとともに、高精細画像を取得することができる。

超音波信号を狭帯域化することができる。バースト波励振 を内部探傷に適用することにより、伝播時の減衰による受 信信号の中心周波数を引き上げることが可能となり、結果 として高精細画像を得ることができた⁷⁾(図5参照)。

5. 超音波におけるすき間の検出限界

ボイドのすき間が微小になると,ボイド界面での超音波 は完全に反射されず,一部通過して検出感度に影響を与え る。したがって,すき間界面での反射挙動を知ることは超 音波の検出限界を検討するうえで重要である。

すき間の検出感度を定量的に調べた従来の例として,平 面ガラスと凸ガラスを重ねたニュートンリングによる方法 がある。しかし,この方法では,すき間を光の干渉縞によっ て測定するため,可視光波長が長いので微小領域での精度 はよくない。また,超音波のビームの幅に対してすき間が 連続的に変化しているので,すき間の絶対値の検出感度の 評価には不向きである。

そこで,この問題を解決するために,ウェーハ面の酸化 膜にエッチングによって段差(すき間)5~500 nmのパ ターンを設けたボイドモデルの試験体を製作して,超音波 のすき間の検出限界について検討した。

すき間が5 nmの場合の超音波探査画像を図6に示す。 同図の画像上の白色部分がエッチングパターン部であり,



図6 すき間の検出感度

ウェーハの酸化膜にエッチングによって5 nmの段差 (すき間)を設けた試験体の超音 波画像の画面例を示す。エッチングパターンが明瞭(りょう)に画像化されている。円 形状の白色像は接合界面に発生した自然ボイドである。

5 nmのすき間も超音波が反射し明瞭(りょう)に画像化し ている。この結果,すき間の検出限界は5 nm 程度はある ことがわかる。なお、同図中にエッチングパターン以外に 見られる大きな白色の像は、接合界面に生じた自然ボイド である⁸⁾。

6. おわりに

ここでは、実装における接合(接着)部の非破壊評価と して. 超音波を利用した検査装置である超音波映像装置 (SAT)の開発,およびその技術応用について述べた。

半導体パッケージの開発リードタイムの短縮、評価コス トの低減といったニーズが高まるにつれて、日立建機株式 会社の超音波映像装置 (SAT)^{9),10)}は、必要不可欠な解析 ツールとして位置づけられていくと考えられる。また、実 装の開発段階では、検査ツールとしての実績もあり、今後 もさらなる研究開発が期待されている。

参考文献など

- 1) 三浦:構造解析に基づく電子パッケージ・モジュールの強度・信頼性評価, エレク トロニクス実装学会誌, Vol.10, No.5, p.427~432 (2007)
- 2)野中:超音波探査映像システムの開発,日立評論,68,6,489~494,(1986.6)
- 3) T.Nonaka, et al.: Ultrasonic imaging and data processing techniques for semi-conductor and new materials, Proc. of 12th WCNDT, Amsterdam, pp.784-789, April (1989)
- 4) K.Kushida, et al.: 100 MHz Band Ultrasonic Transducers Utilizing Epitaxially Grown ZnO Films, Proc. of 9th Symposium on Ultrasonic Electronics, Japanese Journal of Applied Physics, Vol28, Suppl.28-1, 260 (1989)
- 5) 河野, 外: 低音接合技術の開発, 溶接技術, No.5, p.74~79 (1989)
- 6) 有馬, 外: 超音波TECHNO, Vol.49, No.3 (1992) 7) 竹内, 外: バースト波励振による電子部品の超音波検査事例, 日本非破壊検査協
- 会,超音波分科会料,No21682 (2002) 8) 小倉: 超音波画像法によるシリコン貼り合わせ基板界面のボイドの検出技術と高
- 感度化, 応用物理, Vol.66, No.5, p.467~471 (1997) 9)藤井、外:セラミック基板上に直接フリップチップ接合された白色LED光源の信頼 性評価, エレクトロニクス実装学会誌, Vol.12, No.1, p.72~78 (2009)
- 10) 日立建機株式会社, http://www.hitachi-kenki.co.jp

執筆者紹介



1983年日立建機株式会社入社,技術開発センタ企画グループ 所属

現在、新技術の探索に従事 工学博士

日本機械学会会員, 日本非破壊検査協会会員

竹内 健



1991年日立建機株式会社入社,開発・生産統括本部 建設システ ム事業部 電子機器開発センタ 所属 現在, 超音波探触子の開発に従事 エレクトロニクス実装学会会員

牧原 昇也

1989年日立建機株式会社入社,開発・生産統括本部 建設システ ム事業部 電子機器開発センタ 所属 現在,超音波探査映像装置関連に従事



1985年日立建機株式会社入社、開発・生産統括本部 建設システ ム事業部 電子機器開発センタ 所属 現在,建設機械の電動化技術開発に従事

feature e article